

学術研究論文

最近の事例を示す。詳細は、<http://www.iasai.sist.chukyo-u.ac.jp/results.htm>を参照。

学術論文 (2016 年)

- 近藤雄基, 沼田宗敏, 輿水大和, 神谷和秀, 吉田一朗, "Low-pass Filter Without the End Effect for Estimating Transmission Characteristics - Simultaneous attaining of the end effect problem and guarantee of the transmission characteristics -", JJSPE-D-16-00107R1
- Yuki KONDO, Munetoshi NUMADA, Hiroyasu KOSHIMIZU, Kazuhide KAMIYA, Ichiro YOSHIDA, "The Filtering Method to Calculate the Transmission Characteristics of the Low-pass Filters Using Actual Measurement Data", Precision Engineering, 44, pp.55-61 (冊子版) (2016)
- 近藤雄基, 沼田宗敏, 輿水大和, 神谷和秀, 吉田一朗, "ロバスト性調整可能な高速M推定 gaussian フィルタ", 精密工学会誌, 82, 3, pp.272-277 (2016)
- 片山隼多, 吉村裕一郎, 青木公也, 舟橋琢磨, 輿水大和, 加藤久幸, 池野 純, 山村良太, 小口幸成, 福澤満保, "検査員の印象表現に基づいた欠陥候補像の良否判定", 精密工学会誌, 82, 12, pp.1098-1102 (2016.12)
- Yuki Kondo, Munetoshi Numada, Hiroyasu Koshimizu, Kasuhide Kamiya, Ichiro Yoshida, "Low-pass filter without the end effect for estimating transmission characteristics? Simultaneous attaining of the end effect problem and guarantee of the transmission characteristics", Precision Engineering, 10.1016/j.precisioneng.2016.12.007

解説論文 (2017 年)

- 近藤雄基, 吉田一朗, 沼田宗敏, 輿水大和, "表面粗さおよび(ロバスト)フィルタの動向", 非破壊検査, 65, 6, pp.243-249 (2016)
- 輿水大和, "(特集人に学ぶ画像センシング技術の最新動向) 標本化・量子化理論と画像技術イノベーション", 非破壊検査(日本非破壊検査協会誌), 65, 6 (2016.6)
- 輿水大和, "『どれもワタシ。』", 日本顔学会フォーラム顔学2016, 作品展示W-5, 東京藝術大学 (2016.11)

- 輿水, 青木, 舟橋, 三和田, 石井, "グラビア「精密工学会技術賞2016年(第36回)」", 精密工学会誌, 83, 2 (2017.2)
- 輿水, 青木, 舟橋, 三和田, 石井, "(技術解説) 目視検査作業の自動化を目指した人の検査メカニズムのモデル化(傷の気付きアルゴリズム技術開発)", 精密工学会誌, 83, 2 (2017.2)
- 輿水, 青木, 舟橋, 三和田, 石井, "(こぼれ話と苦勞話) 目視検査作業の自動化を目指した人の検査メカニズムのモデル化(傷の気付きアルゴリズム技術開発)", 精密工学会誌, 83, 2 (2017.2)
- 輿水大和, "人工知能研究の最前—産業と社会、学術へのインパクト—", 包装食品技術協会誌, 48, 2, pp.1-8 (2017.2)
- Hiroyasu KOSHIMIZU, Kimiya AOKI, Takuma FUNAHASHI, Yasuhiko MIWATA, Hiroyuki ISHII, "(Special TALK/IW-FCV2017 in Seoul) : KIZKI-algorithm as OMNIPOTENT Image Defect Inspection and Its Applications", Proceedings of FCV2017 (Seoul Korea) (2017.2)
- 輿水大和:『どれもワタシ。』、作品展示W-5、日本顔学会フォーラム顔学2016、2016年11月19-20日(東京藝術大学)